科学研究費助成事業 研究成果報告書



平成 26 年 6月19日現在

機関番号: 1 1 4 0 1 研究種目: 基盤研究(C) 研究期間: 2011~2013

課題番号:23560185

研究課題名(和文)回転円すいの外表面を上昇する液膜流の生成メカニズムと微粒化

研究課題名(英文) Generation mechanism of rising film flow along the rotating conical outer surface and the subsequent atmization characteristics

研究代表者

足立 高弘 (Adachi, Takahiro)

秋田大学・工学(系)研究科(研究院)・准教授

研究者番号:60344769

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 4,100,000円、(間接経費) 1,230,000円

研究成果の概要(和文):本申請者等は,頂角を下にした円すい体を水に浸し回転させることで,円すい体の外表面を液が上昇し,液膜が形成される現象を見い出した。液膜は円すい表面から剥離することなく上昇する。そして最終的には膜の状態を維持できず、液滴となってミスト流として周囲に噴霧される。

この液膜流の上昇メカニズミを明らかにするために,超音波センサーを用いて液膜の厚さを測定し,膜厚と回転数および供給流量との関係を調べた。また,液膜を揚水しミストに微粒化する際に必要となる消費動力を調べるためトルクセンサーを用いた動力計測を行った。その際,水面の位置変化も同時に測定し,回転数と液の揚程およびミスト噴霧流量との関係を調べた。

研究成果の概要(英文): Thin liquid film flow rising along the outer surface of the cone is generated when the cone rotates, which is immersed in the liquid by turning the top upside down. The film flow becomes t hinner as going upward, which leads to atomization of the liquid. We aim to clarify the rising mechanism of the film flow and the subsequent atomization characteristics.

We measured the film thickness using an ultrasonic distance measuring sensor to make clear the rising mech anism and obtained the correlation between the film thickness and the rotation rate. In addition, it is im portant to know the power consumption necessary for the generation of mist flow and rising film flow along the rotating conical outer surface. We measured the torque acting on the rotating cone by using the torque e sensor. The values of torque depend on the mist flow quantity. So, we clarified the relationship between the mist flow quantity and power consumption necessary to pump up the liquid film flow and make the mist flow.

研究分野: 工学

科研費の分科・細目: 流体工学

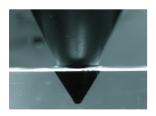
キーワード: 微粒化 薄膜揚水 液膜流 回転円すい 渦糸 ミスト流 噴霧

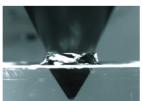
1.研究開始当初の背景

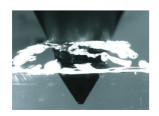
液体微粒化過程では,ファン,コンプレッ サーおよびポンプなどを用いて液体に高圧 をかけ、ノズルから噴出させることで液を微 粒化させる方法がよく用いられている。しか し,複数の機械で構成されるため装置が大き くなることや噴霧特性(液滴の径や噴霧流の 流量など)を制御することが難しいなどの問 題点が存在する。そのため,コンパクトで消 費動力が少なく手軽に噴霧特性を調節でき る新しい噴霧流の生成機構が求められてい る。そのような新しい噴霧流の生成機構とし て,本研究では回転円すい体を利用した方式 に着目する。すなわち、円すい体の頂角を下 にして水に浸し回転させることで,円すい体 の外表面を液が上昇し,液膜を形成し微粒化 する現象を利用して,新しい噴霧流の生成機 構と噴霧流の微粒化特性を調べることが研 究開発当初の背景である。

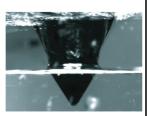
2.研究の目的

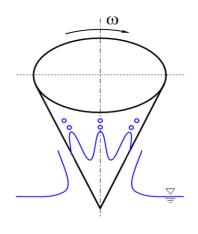
本申請者等は,頂角を下にした円すい体を 水に浸し回転させることで,円すい体の外表 面を液が上昇し,液膜が形成される現象を見 出した。図1は,その様子を高速度ビデオカ メラを用いて可視化した結果であり,回転速 度を 0 から 6000 rpm 程度まで徐々に変化さ せた場合の上昇液膜流のパターンを示して いる。図 1(a) は初期状態で,円すいが静止 している状態である。円すいが回転し始める と,図 1(b) に見られるように水面が持ち上 がる。しかし,この時点では回転速度が小さ いため、それ以上液が上昇することはない。 さらに回転速度を増大させると,図1(c)のよ うに持ち上がった水面位置が高くなり,半径 方向に変形する。そして,変形した水面先端 が,半径方向に放射状に飛散する。水面先端 が飛散した後には,図1(d) に見られるよう に円すい体外表面に沿った均質な薄い液膜 流が形成される。この薄い上昇液膜流は最終 的には図2に示されるように微粒化し液滴と なった後にミスト流として周囲に噴霧され る。







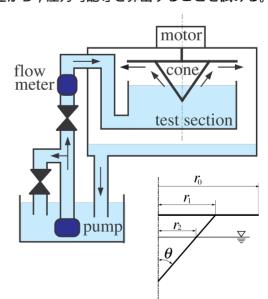


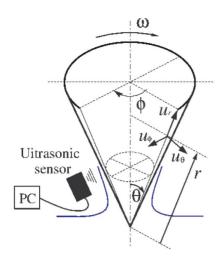


このとき円すい外表面の液膜には遠心力が加わるにも拘わらず液膜が飛散することはない。この興味深い現象を利用して液体を微粒化させ,手軽に噴霧特性を調節でき,なおかつ粒径のばらつきが小さいミスト流を生成する新しい噴霧生成機構についての研究を行う。このような回転円すいの外表面を薄い液膜流が上昇する現象はこれまでに報告例がなく,そのメカニズムは明らかではないので,本研究ではそのメカニズムを明らかにすることが目的である。

3.研究の方法

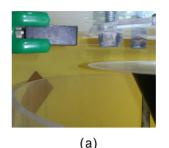
(1) 液膜流の上昇メカニズムを明らかにするためには,液膜流の流速,圧力分布を求めて液膜に加わる力の成分を調べる必要がある。本研究では,液膜流の膜厚を測定することにより,回転速度,浸水位置と液膜厚との関係を調べ,液膜流の微粒化特性を明らかにする。すなわち,液膜流の流量は水位によって判明しているので,特定の位置での平均速度は,膜厚が既知であれば流量を膜厚で割ることによって得ることが出来る。その平均流速から,圧力勾配等を算出することを試みる。



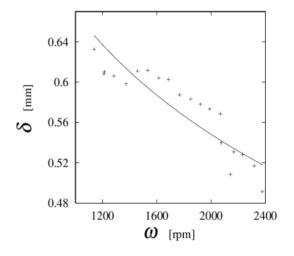


実験装置の概略図を図3に示す。テストセ クションでは,作動媒体である水で満たされ た円筒タンク中心に円すい体が設置される。 円すい体を回転させると,円すい外表面を液 膜が上昇し円すい上部の円板を伝って微粒 化され外部に噴霧流として放出される.放出 された水は回収され,流量を調節した上で再 び円筒タンクに送られる。今回実験に使用し た円すいは,先端角 =30[°],円すい下部 の最大半径 r=40[mm]である。材質はアクリロ ニトリルブタジエンスチレン (ABS) 樹脂で あり,表面粗さ Ra=1.6[μm]である。また, 円すいの表面に特別な処置は与えられてい ない。液膜は高速回転している円すいの外表 面に沿って上昇する。そのため,膜圧を測定 するためには非接触式のセンサーを使用す る必要がある.そこで本研究では,超音波セ ンサを用いて図4のように側面から非接触で 膜厚の測定を行う。

(2) 液膜流の微粒化特性を明らかにする上 で,微粒化の際に必要となる消費動力を明ら にする必要がある。そこで,微粒化に必要な 液の供給量と水面位置との関係および本現 象を実現するのに必要となる消費動力を計 測する。液膜流を維持するには外部から流量 を供給する必要があるが,円すいの回転数と 供給流量の程度により水面水位が変化する。 液はその水面を基準として円すいの底部に 設置された円板まで揚水されるので,必要と なる消費動力を明かにするためには,微粒化 に必要となる動力の他に揚水の動力につい ても考察する必要が生じる。そこで,水面位 置を図5(a)に示される超音波センサーを用い て非接触に計測する.一方,動力に関しては, 図 5(b)に示されるトルクセンサーを用いて計 測を行う。







4. 研究成果

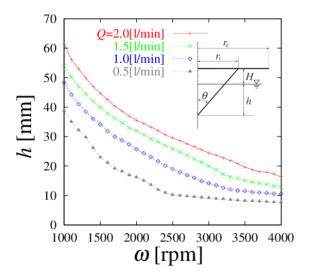
(1) 本研究で膜厚計測に用いるセンサーの分解は 0.003[mm]であり膜厚を測定するのに十分の分解能である。円すいの回転速度は 1000 から 2500 [rpm]で 供給流量は Q=1.0で測定を行う。図 6 は回転速度と膜厚の関係を示したものである.これより,回転速度があるに従って膜厚が減少することがら,本研究の実験条件ではに発ってはなので,回転数が増大するにとから。本研究の実験条件ではに伴い平均流速が増加したことがわかる。これは、回転速度の増加により液膜に作用する関が増大したことがわかる。なり,液膜の揚水に必要な円は、り,液膜上昇の効果が増大したためと考えられる。

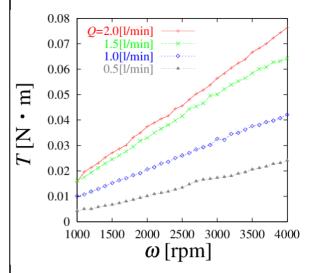
上昇液膜流のメカニズムを明らかにするためには、円すい外表面の速度分布を調べ、その流速の変化率から コリオリカ、遠心力および圧力勾配を求める必要があり、超音波センサーによる膜厚測定と流量とによる平均流速を求める方法に取り組んだ。膜厚と回転速度との定性的な関係が得られたが、上昇液膜流のメカニズムを明らかにするまでには至らなかった。

(2) 液膜流の揚水と微粒化に必要となる消 費動力を調べるために,水面位置を図 5(a) に示される超音波センサーを用いて非接触 に計測する。一方,動力に関しては,図5(b) に示されるトルクセンサーを用いて計測を 行う。円すいの回転速度は 1000 から 4000[rpm]で,供給流量は Q=0.5 から 2.0 [I/min] の範囲で測定を行う。図7は回転速 度と水面水位との関係を示したものである。 図より,回転速度が上昇するに従って水面位 置 h が減少する。それぞれの曲線は流量を一 定とした場合の結果を表わしており,回転速 度の増加に伴ない液を揚水するための遠心 力が増大することになるが,流量が変らない ため,余計に増大した遠心力分を浸水半径を 小さくすることで相殺している。そのため、 回転数が増加すると水面位置が低下する。た だし,このとき液を揚水する高さ H は増加す ることになる。

次に,回転数の増加に伴うトルクの測定結果を図8に示す。先に示したように,回転数が増加すると揚水高さHが増加する。図8より,回転数の増加に伴いトルクの測定値が増加することがわかる。すなわち,回転速度が増大し,水面位置が減少すると揚水距離Hが増大することになるので,揚水に必要な動力が余分に必要となるためトルク T が増大する結果になる。

円すいの回転による水面水位の変化と必要なトルクを調べ,微粒化および液膜流の揚水に必要となる消費動力に関する考察を行った。実用的な整理式を導出することを試みたが,実験条件の制約から結果のデータ数が足りず,回転速度と水面水位および消費動力の間の関係を得るまでには至らず,上昇液膜流の生成メカニズムと微粒化特性の解明には至らなかった。





(3) 本研究で取り扱った,回転円すいの外表面を薄い液膜流が揚水され,最終的には膜状流の条件を維持できずに液滴に分裂し,ミスト流となって周囲に噴霧される一連の現象は,これまでに研究例がなく不明な多く非常に興味深い現象である。 今回の研究期間で十分に解明できなかった部分について,今後もさらに研究を続けていく必要がある。

5 . 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計1件)

1, <u>足立高弘</u>, 回転円すいを用いて生成されるミストによる酸素濃度の溶解促進, 日本機械学会論文集(B編),第79巻800号, pp. 632-165(2013 4), 査読有り

[学会発表](計 10件)

- Takahiro Adachi and Akihiro Arai: Mist
 Type Purifier Using Pumping-up
 Mechanism Generated by Thin Film Flow,
 24th European Conference on Liquid
 Atomization and Spray Systems, Estoril,
 Portugal, September 5-7, 2011, CD-ROM.
- 2, Keisuke Matsuda, Takahiro Adachi, Yusuke Ryu, Okajima Junnosuke and Takeshi Akinaga: Generation Mechanism of Rising Film Flow along the Rotating Conical Outer Surface and the Subsequent Atomization Characteristics. Proc. 9th International Conference on Fluid Dynamics, Sendai, Japan, September 19-21, 2012, pp.158-159.
- 3, <u>Takahiro Adachi</u>, Water purification technique using the mist flow generated by a rotating cone, Proc.

International Symposium on Green Manufacturing and Applications, Honolulu, Hawaii, USA, June 25-29, 2013.

- 4, Keisuke Matsuda, <u>Takahiro Adachi</u>, Okajima Junnosuke and Takeshi Akinaga: Generation Mechanism of Rising Film Flow along the Rotating Conical Outer Surface and the Subsequent Atomization Characteristics, Proc. of the 13th International Symposium on Advanced Fluid Information, November 25-27, 2013, Sendai, Japan, p.158-159.
- 5, <u>Takahiro Adachi</u>, Float-type water purifier using the mist flow generated by rotating cones, Proc. Water Supply and Water Quality-Water 2014, June 20-25 Torun. Poland 発表予定.
- 6, Keisuke Matsuda, <u>Takahiro Adachi</u>, Okajima Junnosuke and Takeshi Akinaga: Generation Mechanism of Rising Film Flow along the Rotating Conical Outer Surface and the Subsequent Atomization Characteristics, Proc. 11th International Conference on Fluid Dynamics, Sendai, Japan, October 8-10, 2014, 発表予定.
- 7,新井晶大,<u>足立高弘</u>:回転円すいによる 薄膜揚水メカニズムを用いたミスト型水 質浄化装置の開発,日本機械学会東北支 部第47期秋季講演会講演論文集No.2011, (2011年9月22日)pp.284-285.
- 8, <u>足立高弘</u>,新井晶大:回転円すいによる ミストの生成と酸素濃度の溶解促進,第 20回微粒化シンポジウム講演論文集, (2011年12月19日) pp.211-214.
- 9, 竜優介,<u>足立高弘</u>:自律的で自由自在に 水面を移動できる推進機構を備えた回転 円すい浮体式水質浄化装置の開発、日本 機械学会東北支部第 47 期秋季講演会講 演論文集 No.2011, (2011 年 9 月 22 日) pp.326-327
- 10, 松田圭祐, <u>足立高弘</u>:回転円すいの外表面を上昇する液膜流と噴霧流の生成に必要な消費動力量と噴霧流量との関係,日本機械学会熱工学コンファレンス 2013 講演論文集(2013 年 10 月 19,20日)pp.75-76.

[図書](計 0件)

〔産業財産権〕 出願状況(計 1件)

名称:繊維の製造装置およびこれを用いた不

織布の製造方法 発明者:<u>足立 高弘</u> 権利者:秋田大学

種類:

番号:特願 2014-090840

出願年月日:平成26年4月25日

国内外の別: 国内

取得状況(計 0件)

[その他]

ホームページ等

http://www.mech.akita-u.ac.jp/~lab-adac hi/99 blank005.html

6.研究組織

(1)研究代表者

足立 高弘 (ADACHI Takahiro)

秋田大学・大学院工学資源学研究科・准教授

研究者番号: 21225643